

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 61092020 A

(43) Date of publication of application: 10.05.86

(51) Int. CI

H03H 9/19 H01L 21/302 H03H 3/02

(21) Application number: 59213042

(22) Date of filing: 11.10.84

(71) Applicant:

NIPPON DEMPA KOGYO CO LTD

(72) Inventor:

CHIBA AKIO

NAKAJIMA MIKIO

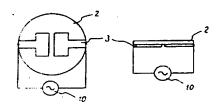
(54) PIEZOELECTRIC VIBRATOR HAVING ETCHING **MONITOR**

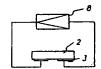
(57) Abstract:

PURPOSE: To monitor the etching state of a piezoelectric diaphragm by providing split electrodes in pairs to one side of the piezoelectric diaphragm and applying an AC current to the split electrodes to as to attain horizontal electric field excitation.

CONSTITUTION: When a crystal resonator is used for the piezoelectric vibrator, since the resonance frequency is inversely proportional to the thickness of a crystal flat plate 2 in general, a resonance frequency (f) inversely proportional to the thickness (t) including the thin split electrode 3 provided on one side is expressed as f=K/t (where K is a thickness frequency constant). When the face opposite to the face having the split electrodes 3 is subject to, e.g., dry etching or reactive ion etching under vacuum, the increment Af of the frequency corresponding to the decrement Δt of the thickness thereby is expressed as $\Delta f = -K'f^2 \Delta t$, and the etching amount Δf is can be known by monitoring the Δf . A loop oscillating circuit network known as the transmission method having a phase adjusting amplifier 8 is used for the purpose.

COPYRIGHT: (C)1986, JPO& Japio





⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-92020

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和61年(1986)5月10日

H 03 H 9/19 H 01 L 21/302 H 03 H 3/02 7210-5J E-8223-5F

7210-5」 審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

公発明の名称

エツチングモニタ装置を有する圧電振動子

②特 顋 昭59-213042

20出 願 昭59(1984)10月11日

砚 明 者 千 葉 亜 紀 雄

東京都渋谷区西原1丁目21番2号 日本電波工業株式会社

内

郊発 明 者 中 島

幹 雄

実

東京都渋谷区西原1丁目21番2号 日本電波工業株式会社

内

⑪出 願 人 日本電波工業株式会社

介代 理 人 弁理士 辻

東京都渋谷区西原1丁目21番2号

明細 🏞

1 ・ 是明の名称

エッチングモニタ装置を有する圧電振動子

2・特許請求の範囲

(1) 圧電振動板の片面に対になった分割電極を 設け、 缺分割電極に交番電流を供給して水平電界 助服を行なわせ、圧電振動板のエッチング状態を モニタできるようにしたことを特徴とするエッチ ングモニタ装置を有する圧電振動子。

(2) 前紀圧電振動板は水晶からなることを特徴 とする特許請求の範囲的(1) 項記載のエッチン グモニタ装置を有する圧電振動子。

(3)前記対になった分割電極は複数組を有する 多電極型であることを特徴とする特許請求の範囲 部(1)項又は第(2)項記載のエッチングモニ タ装置を有する圧電振動子。

3・発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、エッチングモニタ装置を有する圧電程 動子に係り、特に、水晶の片面をエッチングする 場合にその反対側に一対の電板を配鉄し、水平電 界励級を行ない得るようにしたエッチングモニタ 装置を有する圧電振動子に関する。

(登米技術)

通常、圧電振動子をドライエッチングする場合には、第7回に示されるように、エッチング台 1 の上に圧電振動子 2 を配置して、この圧電振動子 2 の上面を、例えば、C H 4 ガスによってドライエッチングするようにしている。

そして、エッチング是はエッチング時間によったり、オペレータの感によりエッチングされた圧電振動子をころあいをみはからってピックアップし、そのピックアップされた圧電振動子をメータ等により制定してエッチング量の監視を行なっていた。

(従来技術の問題点)

前記したエッチング量の監視方法は、面倒であり、省人化、省力化上問題があるばかりでなく、 圧電振動子の品質及び信頼性の向上という点から も問題であった。



本発明は、上記の問題点を解決するために、圧 電報効子をドライエッチングする場合にエッチン グの進行状況を監視して退速、かつ的確にエッチング状況を把握し得るエッチングモニタ製造を利 する圧電振動子を提供することを目的とする。 (条項の概要)

本是明は、圧電銀動板の片面に対になった分割 電極を設け、鉄分割電極に交番電波を供給して水 平電界助振を行なわせて、圧電振動板のエッチン グ状態をモニタできるようにすることを特徴とす るものである。

(実施例)

以下、本発明の一変施例を図面を参照しながら
詳細に説明する。

第1回は本発明に係るエッチングモニタ装置を 有する圧電振動子を説明する図であり、第2回は 当該圧電振動子の解画図である。図において、2 は圧電平板、3はモニタ用分割電板、10は高周 按電視である。 圧竜平板という)2の片面に一対のモニタ用分様 電板3を配置し、その電極3に高周被電数10か ら交番電流を流し、一封の電極3.3間に水平電 界(第4回参照)をかけて水晶片でを顕振させる 。即ち、圧電結晶の電気軸に対し斜め方向に切断 した圧電平板でを設け、その圧電平板での片面に 動揺のための分割電極3を設けて、交番電界をか けると平面の境界条件を満足する共根点付近で共 原現象がみられる。 勿論、この共振は電気軸に沿 った電界成分によって圧電平板が強制動振される ために生起するものであるために、一般にその圧 電平板2の四面対向電機構造の場合の共振と比べ ると共観レベルは弱い。従って、一般の発振法に よらず、的3図に示されるように、伝送法と称さ れるループの発展回路網を設け、そのループ間に 当該圧電振動子を間隔させて用いるようにするの が望ましい。この時、当該圧電振動子の海蟾子間 の位相がほぼりになるように位相調整増構器8に よって調整され、かつ振幅が発掘に十分なように

図から明らかなように、圧電結晶平板(以下、

増幅される。

次に、当該圧電振動子を水晶振動子とした場合 について説明する。

水品片の場合は、ATカットはY動から約35 の付けた結晶板を用いる。一般に、結晶板の厚みに反比例した関有調数数、つまり共振周数数を示すが、第4図のように、この場合にも、片面に付い設された向い分割電極3を含めて厚みとに反比例した共振周数数を有する。即ち、

$$f = K / t \qquad \dots (1)$$

が成立する。ここで K は厚み 関数数定数である。 そこで、分割電極 3 が付設された面と反対側の 面が、例えば、真空中でドライエッチングまたは リアクティブイオンエッチングと称されるエッチ ング (性剣) を受けると、これによって厚みが親 じた分 4 にだけ関数数が高くなる。 つまり、 周被 数 4 に だけ 関数数が高くなる。 即ち、

 グ量を知ることができる。

ところで、第5図に示されるように、圧電銀動 子の構造として、圧電平板2の分割電極3が付際 された個と反対側にエッチングすべき物質というで も数数を付着し、この物質額4をエッチングすると行道である。この場合はエッチング がガスの選択特性による被エッチング物のエッチング 少グ分析性を同一にできる。即ち、質量付加効果の での効果によってそのエッチング量を正確に知る ことができる。

前記したように、圧電平板2の片面にのみ配数された分割電極3の電気輸成分電界による助扱のため振めて買いレベルでしか共振が観測できないので、この欠点を持うため第6回に示されるように、分割電極を交互に複数組設けた多電極型のものとすることができる。

尚、当該圧電振動子の複動を一ドは圧電結晶板の同間を境界条件とするものであれば、例えば、 にり、面すべり、腰、屈曲など自由に用いること ができる。また、圧電振動子は結晶板だけでなく

特開昭61-92020(3)

適当な斜方向分極を施すことによりセラミックなども使用することができる。更に、ATカットは 製度特性の点で有利である。また、半線体などの SiO2 エッチングに別な物質を付着せず、その まま利用することができる。

(発明の効果)

本発明によれば、圧電振動板の片面に対になった分割電極を設け、試分割電極に交番電視動板のよれで、圧電視動板のエス・チング状態をモニタできるようにしたので、従来・面倒であったエッチングに係る作業の効率化を図ることができる。従って、本発明は、名及びの力化を推進すると共に圧電振動子の品質とびら気性の向上を達成し得るという効果を実することができる。

4・図面の簡単な説明

第1 図は本発明に係る圧電振動子の説明図、第 2 図は当該圧電振動子の新面図、第3 図は当該圧 電振動子の共振レベルをアップさせるための説明 図、第4 図は当該圧電振動子の動振を説明するた めの圧電振動子の断面図、第 5 図及び第 6 図は他の実施例を示す圧電振動子の断面図、第 7 図は従来の圧電振動子のエッチングを説明する説明図である。

2 … 圧電結晶平板、 3 … 分割電極、 4 … 被エッチング物質と同一な物質膜、 8 … 位相調使増報器 1 0 … 高周被電影。

特許出順人 日本電被工業株式会社 代 理 人 弁理士 辻 實

